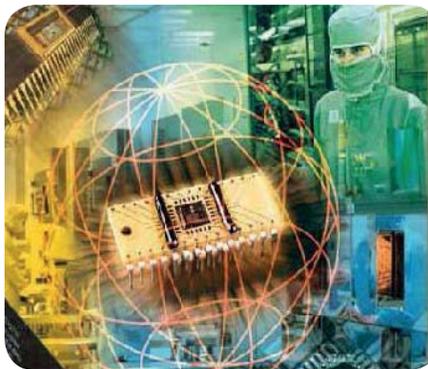


COMET

CONTAMINATIONS METALLIQUES ET PERFORMANCES DES COMPOSANTS

> OBJECTIF DU PROJET



Le projet COMET a pour objet d'améliorer la connaissance des contaminants métalliques afin de maîtriser leur influence sur ces nouvelles technologies, ce qui conduit à définir les objectifs de développement suivants : établir la relation entre contamination contrôlée et les performances des composants, modéliser le comportement des contaminants métalliques au cours du procédé, explorer de nouvelles techniques de caractérisation permettant d'adresser les besoins analytiques des technologies hétérogènes embarquées, améliorer les procédures de nettoyage dans le but de minimiser la contamination apportée par les équipements et maîtriser les méthodes de contamination

sur plaquettes.

En résumé, le projet vise à lever les verrous technologiques liés à la quantification de l'impact de la contamination sur les dispositifs microélectroniques avancés, en améliorant les performances de certaines techniques analytiques (en termes de limites de détection et de résolution spatiale). Les méthodes et moyens prévus pour lever ces verrous sont d'une part la mesure de niveaux très faibles avec des techniques expérimentales nouvelles, et d'autre part des simulations et des tests électriques ciblés et innovants.

> PORTEUR DU PROJET



> PARTENAIRES



> FINANCEMENT

- Année de sélection : 2010
- Appel à projets : FUI9
- Financeurs :



- Durée du projet : 36 mois
- Budget : 4,3M€

> RETOMBÉES ATTENDUES

- 9 emplois
- 22 publications



MICROÉLECTRONIQUE

